

走査型電子顕微鏡（FE-SEM）SU-8020

製造元	日立ハイテクノロジーズ
仕様	コールドFE電子銃を搭載したセミインレンズタイプのFE-SEM
保有部署	機械系共通 顕微鏡室
設置場所	桂・C3棟・地下1階cB1S05室)
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/ko08qo.pdf
注意事項等	原則として依頼測定のみ。利用者自身による測定は不可。
連絡先	機械系共通 顕微鏡室 075-383-3736 ishikawa.kosuke.3s@kyoto-u.ac.jp
キーワード	表面形状観察、微細構造、膜厚測定
機器コード	0000109001
自由記入欄	本装置は、超高分解能観察に適したコールドFE電子銃を搭載したセミインレンズタイプのFE-SEMである。 可動範囲はx,yともに±25mm、最大試料サイズはΦ100mm。 イオンスパッタ装置（日立 E-1030）があるので、導電性コーティング（白金パラジウム）が可能。 なお、下記の試料は観察不可。 ・含水、含油 ・粉末磁性体

